

Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD



Производитель:

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка плазмохимического осаждения Vision 410 PECVD компании Plasma-Therm— это компактная, надежная, экономически эффективная и простая в эксплуатации и обслуживании установка плазмостимулированного осаждения из газовой фазы для R&D-лабораторий, мелкосерийных, пилотных и серийных производств.

Установка Vision 410 PECVD позволяет осаждать следующие материалы:

- Диэлектрики: SiO₂, SiN_x, SiO_xN_y;
- Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Vision 410 PECVD:

- Большая область загрузки — круглый стол диаметром 406 мм, который позволяет обрабатывать подложки разных форм и размеров.
- Равномерность осаждаемого покрытия по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше $\pm 2\%$.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI).
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.

Стандартная комплектация

- Система отслеживания окончания процесса:
 - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
 - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
- Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме),
- Специальные держатели образцов,
- Пакет для установки через стенку ЧПП,
- Расширенная гарантия производителя